

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】令和2年11月12日(2020.11.12)

【公表番号】特表2019-531187(P2019-531187A)

【公表日】令和1年10月31日(2019.10.31)

【年通号数】公開・登録公報2019-044

【出願番号】特願2019-520617(P2019-520617)

【国際特許分類】

B 0 5 B 16/40 (2018.01)

B 0 5 B 13/02 (2006.01)

B 0 5 B 14/40 (2018.01)

B 0 5 D 1/02 (2006.01)

B 0 5 D 3/00 (2006.01)

【 F I 】

B 0 5 B 16/40

B 0 5 B 13/02

B 0 5 B 14/40

B 0 5 D 1/02 Z

B 0 5 D 3/00 A

B 0 5 D 3/00 C

【手続補正書】

【提出日】令和2年9月25日(2020.9.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

室を通過するように配置されるウェブまたはストリップなどの材料片(M)に流体を塗布するための室であって、

前記材料に流体を塗布するための流体塗布器と、

前記室内に供給される材料が通る入口と、

前記室から出る材料が通る出口と、

前記出口に配置されるとともに前記室の出口流体シールを形成するように構成された出口通路装置と、

前記入口に配置されるとともに前記室の入口流体シールを形成するように構成された入口通路装置と、

残余流体を回収および処理するように構成された少なくとも一つの排出口と、  
を有し、

前記入口通路装置は、前記室の少なくとも一つの内面に沿って前記少なくとも一つの排出口に向けて残余流体を誘導するように構成され、

前記少なくとも一つの内面は、前記材料(M)が前記室を通過する方向(V)に垂直な軸(H)に対して20°~85°の間の傾斜( )を有する、室。

【請求項2】

前記入口通路装置および/または前記出口通路装置は、前記流体塗布器によって前記材料(M)に塗布された残余流体を回収するようにさらに構成されている、請求項1に記載の室。

## 【請求項 3】

前記出口通路装置および前記入口通路装置は、前記装置を前記材料 (M) が通り抜けるように形状設定されている、請求項 1 または 2 に記載の室。

## 【請求項 4】

前記出口通路装置および前記入口通路装置は、前記材料 (M) と前記室との間に流体シールを形成するために、前記材料 (M) に当接するように構成された少なくとも一つの細長いシールリップを含み、前記少なくとも一つのシールリップは、好ましくは可撓性である、請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の室。

## 【請求項 5】

前記出口通路装置は、第 1 と第 2 のシールリップを含み、前記第 1 と第 2 のシールリップは、二つのシールリップ間または前記室と前記材料 (M) との間に出口流体シールを形成するように、互いに前記出口の反対側に配置されている、請求項 4 に記載の室。

## 【請求項 6】

前記入口通路装置は、第 1 と第 2 のシールリップを含み、前記第 1 と第 2 のシールリップは、二つのシールリップ間または前記室と前記材料 (M) との間に入口シールを形成するように、互いに前記入口の反対側に配置されている、請求項 4 または 5 に記載の室。

## 【請求項 7】

前記少なくとも一つの排出口は、前記入口の各側に一つずつ、前記室の底に配置された二つの排出口を有し、前記室は、前記出口の各側に一つずつ、前記室の第 1 と第 2 の側壁に配置された二つの流体回収用輪郭部をさらに有し、前記輪郭部は、残余流体を前記排出口に向けて誘導するように構成され、前記出口通路装置は、前記室の少なくとも一つの内面に沿って前記二つの流体回収用輪郭部に向けて残余流体を誘導するように構成されている、請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載の室。

## 【請求項 8】

前記流体塗布器は、流体を非接触塗布するための噴霧塗布器である、請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の室。

## 【請求項 9】

前記材料 (M) は、前記室を略垂直方向 (V) に通過する、請求項 1 ~ 8 のいずれか一項に記載の室。

## 【請求項 10】

前記室は、前記入口および前記出口によって隔てられた第 1 と第 2 の室部によって画成されている、請求項 1 ~ 9 のいずれか一項に記載の室。

## 【請求項 11】

室入口と室出口との間で室を通過するウェブまたはストリップなどの材料片 (M) に流体を塗布するように構成された塗布器を有する室であって、前記室は、手段をさらに有し、前記手段は、出口および入口に配置され、流体塗布の結果として生じる残余流体または霧が室から出ることができないように室をシールするように構成されている、室。

## 【請求項 12】

請求項 1 ~ 11 のいずれか一項に記載の室を備えた、噴霧ユニット。

## 【請求項 13】

請求項 12 に記載の噴霧ユニットを通過するウェブまたはストリップなどの材料片 (M) に流体を塗布する方法であって、流体を塗布するステップは、流体の非接触塗布、例えば噴霧、を好ましくは伴い、前記方法は、

前記室の出口に配置された少なくとも一つの通路装置および前記室の入口に配置された少なくとも一つの通路装置によって、前記材料 (M) と前記室との間に流体シールを形成するステップと、

前記室内に配置された流体塗布器によって、前記材料 (M) の少なくとも一つの面に流体を塗布するステップと、を含む方法。

## 【請求項 14】

少なくとも一つの排出口、および / または前記室内に配置された少なくとも一つの流体

回収用輪郭部によって、残余流体を回収するステップをさらに含み、前記流体シールを形成するステップは、前記少なくとも一つの通路装置に提供される少なくとも一つの細長い可撓性シールリップによって好ましくは実施される、請求項13に記載の方法。